

und mißt den Winkel zwischen ihm und der erwähnten Halbierungsebene. Er entspricht der Ergänzung der gesuchten Auslöschungsschiefe zu  $90^\circ$ , also der zweiten Auslöschungsschiefe. Beispielsweise ist in Fig. 427 die Schiefe der Auslöschung für einige Flächen der Zone  $\{010\}$ :  $\{100\}$  bei Augit graphisch bestimmt.

Noch anschaulicher läßt sich die Lage des Auslöschungskreuzes auf einer Fläche eintragen, wenn man ihren Pol in der stereographischen Projektion durch entsprechende Drehung in den Projektionsmittelpunkt bringt; die Fläche liegt dann dem Grundkreis parallel (vgl. S. 22). Die optischen Achsen haben entsprechend ihre Lage geändert. Man konstruiert ganz wie oben die Auslöschungs-

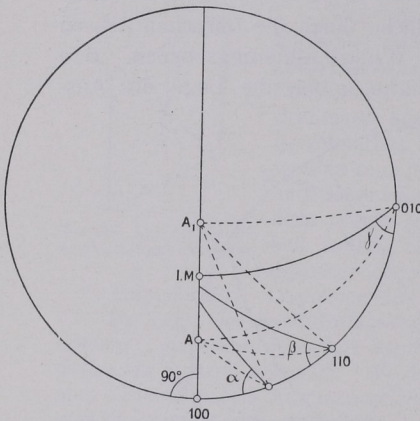


Fig. 427. Konstruktion der Auslöschungsrichtungen auf Flächen der c-Achsenzone von Augit.

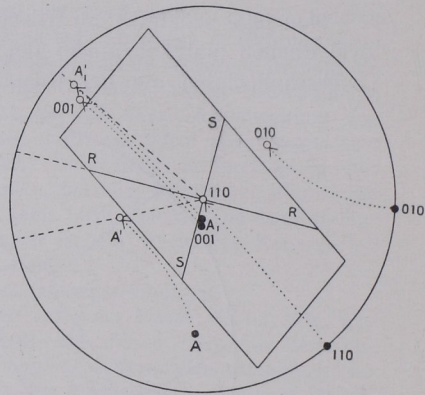


Fig. 428. Konstruktion der Auslöschungsrichtungen auf  $\{110\}$  von Augit.

richtungen, indem man Ebenen durch den Mittelpunkt und die optischen Achsen  $A'$  und  $A'_1$  legt und den Winkel halbiert. Die Einschnitte der Kreisebenen erscheinen jetzt als gerade Linien. Die Umgrenzung der Fläche wird wie üblich (S. 21) gezeichnet. In Fig. 428 ist in der Weise die Auslöschung auf  $\{110\}$  eines Augits konstruiert.  $RR$  und  $SS$  bilden das Auslöschungskreuz.

## 24. Auslöschungskurven.

Die Dreh- bzw. Umhüllungsapparate (S. 89) bieten die Möglichkeit, die Lage des Auslöschungskreuzes z. B. in einer Zone fortlaufend zu verfolgen, indem man die Kristallplatte bzw. den ganzen Kristall entsprechend wendet und jeweils nach kleinen Veränderungen beobachtend die Auslöschungsrichtungen feststellt. Es lassen sich dann